

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 2 部門第 4 区分
【発行日】 令和 6 年 4 月 4 日(2024.4.4)

【国際公開番号】 W O 2 0 2 3 / 0 3 3 1 4 6
【出願番号】 特願 2023-545697(P2023-545697)
【国際特許分類】

B 3 2 B 15/08(2006.01)
C 0 8 F 20/10(2006.01)
C 0 8 F 12/04(2006.01)
C 0 8 F 26/06(2006.01)
H 0 1 L 21/312(2006.01)

10

【F I】

B 3 2 B 15/08 A
C 0 8 F 20/10
C 0 8 F 12/04
C 0 8 F 26/06
H 0 1 L 21/312 A

【手続補正書】

20

【提出日】 令和 6 年 1 月 4 日(2024.1.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に存在する金属表面の少なくとも一部に、吸着基および単量体に由来する構造単位を有する化合物を含む膜が形成されており、
該金属の比重が、 19.30 g/cm^3 以下である、成膜基板。

30

【請求項 2】

上記吸着基が、SH 基、リン酸基、ホスホン酸基、カルボン酸基、イソシアネート基、不飽和炭化水素基、ハロゲン化アルキル基、およびアミノ基からなる群より選択される基の 1 種以上である、請求項 1 に記載の成膜基板。

【請求項 3】

上記単量体に由来する構造単位が、(メタ)アクリル酸エステルに由来する構造単位、及び芳香族基含有単量体に由来する構造単位から選択される 1 種以上の構造単位を含む、請求項 1 に記載の成膜基板。

【請求項 4】

40

上記単量体に由来する構造単位が、(メタ)アクリル酸エステルに由来する構造単位、及び芳香族基含有単量体に由来する構造単位から選択される 1 種以上の構造単位を含む、請求項 2 に記載の成膜基板。

【請求項 5】

基板上に存在する金属表面の少なくとも一部に、吸着基および単量体に由来する構造単位を有する化合物を含む膜が形成されており、
E S C A で検出された、該膜の炭素元素の割合と該基板の炭素元素の割合との差が、5 % 以上である区画部分を有する、請求項 1 ～ 3 の何れかに記載の成膜基板。

【請求項 6】

前記化合物の重量平均分子量が $1000 \sim 40$ 万である、請求項 1 ～ 3 の何れかに記載の

50

成膜基板。

【請求項 7】

基板上に存在する金属表面の少なくとも一部に、吸着基および単量体に由来する構造単位を有する化合物を含む膜が形成されており、
E S C A で検出された、該膜の炭素元素の割合と該基板の炭素元素の割合との差が、5 %
以上である区画部分を有する、請求項 4 に記載の成膜基板。

【請求項 8】

前記化合物の重量平均分子量が 1 0 0 0 ～ 4 0 万である、請求項 5 に記載の成膜基板。

【請求項 9】

前記化合物の重量平均分子量が 1 0 0 0 ～ 4 0 万である、請求項 4 又は 7 に記載の成膜基板。

10

【請求項 1 0】

基板上に存在する金属表面の少なくとも一部に、吸着基を有する重合体を含む組成物の膜を形成する工程を含む、成膜基板の製造方法。

【請求項 1 1】

基板上に存在する金属表面の少なくとも一部に、吸着基を含む重合開始剤を供給する工程（Ⅰ）と、重合開始剤を供給した金属表面に単量体を供給する工程（Ⅱ）と、該単量体を重合する工程（Ⅲ）と、を含む成膜基板の製造方法。

20

30

40

50